

公開番号／特許登録番号	特許5768055
発明の名称	基体
出願人または特許権者	株式会社 フジクラ 国立大学法人 東京大学

発明の内容 (概要)

本発明は、微粒子をトラップする微小吸引孔を備えた基体、及び基体の製造方法に関するもの。

基体であって、基材（４）と、前記基材（４）内に設けられ、内壁面を有し、流体を流通させる流路（３）と、前記内壁に設けられ、前記流路（３）と前記基材（４）の外部とを連通させ、開口部を有する微小吸引孔（１）と、前記内壁のうち前記微小吸引孔（１）の開口部に近い位置に配置され、前記流体の流れを緩める緩流部（P）と、を含み、前記基材のうち、少なくとも前記微小吸引孔（１）を構成する部位は、単一の部材で形成されていることを特徴とする基体。

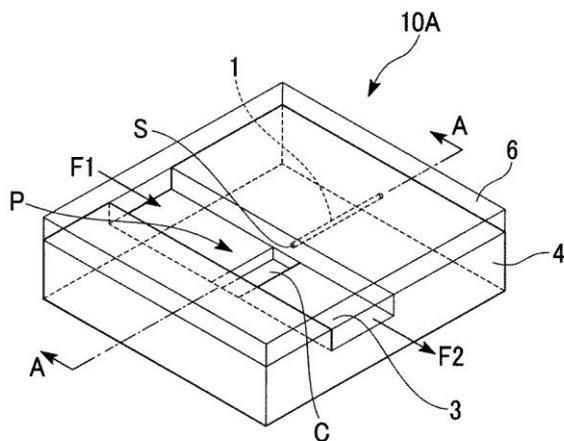


図1 基体の一例を示す模式的な斜視図

- C:凹部
- T:微粒子（微生物又は細胞）
- R:流体
- S：吸着部

- F1：上流側
- F2：下流側

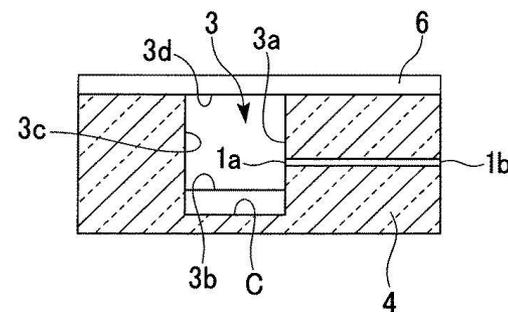


図2 図1のA-A線に沿う断面図。

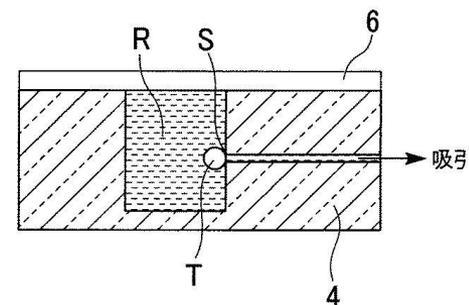


図3 図2の断面図において、微粒子が吸着部にトラップされた様子を示す模式図